

## ОПТИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ ЛАЗЕРНООСАЖДЕННЫХ ПЛЕНОК CuGaSe<sub>2</sub> ВБЛИЗИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО КРАЯ ПОГЛОЩЕНИЯ

В. В. Киндяк, А. С. Киндяк, В. Ф. Гременок, И. В. Бондарь,  
Ю. В. Рудь, Г. А. Медведкин

Институт физики твердого тела и полупроводников Академии наук Беларуси, 220726, Минск, Беларусь

(Получена 28 января 1993 г. Принята к печати 26 февраля 1993 г.)

Приводятся результаты расчета оптических констант высокоориентированных лазерноосажденных пленок CuGaSe<sub>2</sub> по интерференционным спектрам отражения и пропускания. Изучена структура краевого поглощения в тонких пленках CuGaSe<sub>2</sub>.

В последнее время значительно возросло внимание к тонкопленочным структурам на основе халькопиритных полупроводников I—III—VI<sub>2</sub>, обладающих высоким коэффициентом поглощения, хорошей технологичностью и перспективными для создания на их основе эффективных солнечных элементов. К этой группе материалов относится и тройное соединение CuGaSe<sub>2</sub>, объемные кристаллы которого изучены довольно подробно [<sup>1, 2</sup>]. Однако до настоящего времени существует проблема получения совершенных пленок CuGaSe<sub>2</sub> стехиометрического состава. В литературе имеются сведения о получении и исследовании только поликристаллических слоев CuGaSe<sub>2</sub> с отклонениями от стехиометрии [<sup>3, 4</sup>]. Ввиду этого до сих пор не удалось получить однозначных данных об оптических свойствах тонких пленок CuGaSe<sub>2</sub>, особенно критичных к условиям их изготовления и оказывающих существенное влияние на параметры и эффективность фотопреобразователей на их основе.

В настоящей работе исследованы оптические свойства высокоориентированных стехиометрических пленок CuGaSe<sub>2</sub>, полученных на стеклянных подложках при оптимальной  $T_s = 375$  °C методом импульсного лазерного испарения, описанного ранее в [<sup>5, 6</sup>]. Напыление пленок CuGaSe<sub>2</sub> проводилось в вакуумной камере при давлении  $2 \cdot 10^{-5}$  Тор с помощью лазера, работающего в режиме свободной генерации с длиной волны 1.06 мкм, длительностью импульса 1.1 мкс и энергией в импульсе 160–200 Дж.

Оптические константы пленок CuGaSe<sub>2</sub> (действительная  $n$  и мнимая  $k$  части показателя преломления, коэффициент поглощения  $\alpha$  и диэлектрическая проницаемость  $\epsilon$ ) определялись по интерференционным спектрам отражения  $R(\lambda)$  и пропускания  $T(\lambda)$  в видимой и ближней инфракрасной областях спектра (400–1700 нм) при комнатной температуре. Спектральное распределение коэффициента отражения  $R(\lambda)$  измерялось на спектрофотометре Beckman-5240 с использованием спектрального вычислительного комплекса КСВУ-3М. Для измерения применялась специальная приставка с симметричным ходом лучей, близким к нормали. Спектральное разрешение установки в коротковолновой области спектра составляло 0.5 мэВ. Ошибка в амплитуде  $\Delta R \cong 3\%$ . Спектры пропускания пленок CuGaSe<sub>2</sub> на прозрачной подложке снимались на спектрофотометре Perkin—Elmer-280. Толщина пленок составляла 0.6 мкм. Интерференция на спектрах отражения и пропускания свидетельствует, так же как и данные

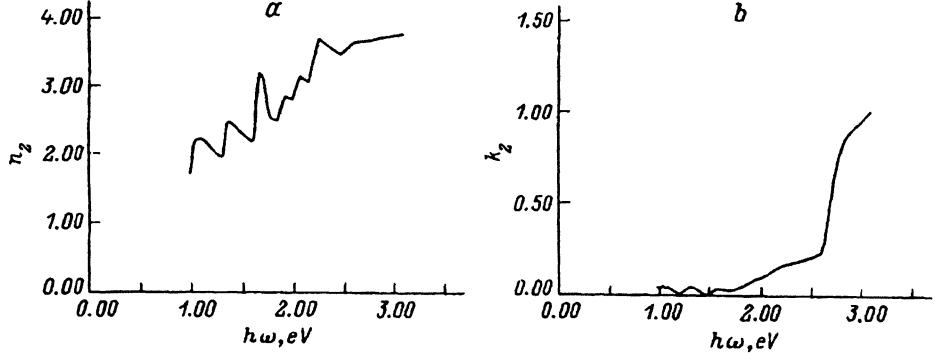


Рис. 1. Дисперсия действительной (а) и мнимой (б) частей показателя преломления для пленки CuGaSe<sub>2</sub>.

рентгеновских дифракционных исследований, о совершенстве полученных слоев CuGaSe<sub>2</sub>.

Как известно, учет всех оптических явлений в системе пленка—подложка, включая интерференцию, приводит к сложным трансцендентным уравнениям, связывающим показатели преломления  $n$  и поглощения  $k$  пленки с измеренными  $R(\lambda)$  и  $T(\lambda)$  [7–9]. Использование компьютера дает возможность успешно решать данную задачу, что в свою очередь позволяет получить наиболее полную информацию о дисперсии оптических констант в тонких слоях, о зонной структуре тонкопленочных полупроводников и в данном случае о структуре краевого поглощения в пленках CuGaSe<sub>2</sub>.

Используемая для расчетов оптических констант тонких пленок система уравнений имеет вид [10]

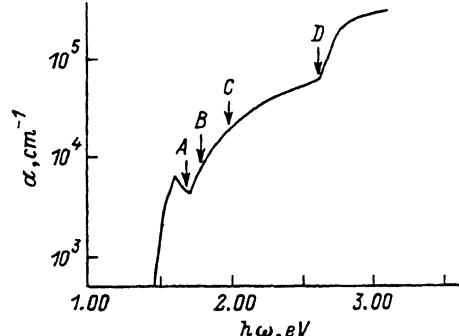
$$T_{14} = \frac{1 - R_{12}}{1 - R_{12}R_a},$$

$$R_{14} = \frac{R_{12}T_a^2}{1 - R_{12}R_a} + R_a. \quad (1)$$

Здесь  $R_{12} = (n_2 - 1)^2 / (n_2 + 1)^2$  — френелевский коэффициент отражения на границе пленка—воздух,  $R_a = C/A$ ,  $R'_a = B/A$ ,  $T_a = 16n_3(n_2^2 + k_2^2)/A$ ,  $T_{14}$  и  $R_{14}$  — измеренные коэффициенты пропускания и отражения системы пленка—подложка. Показатель преломления исходной ( $n_1$ ) и конечной ( $n_4$ ) фаз равен единице. Показатель преломления подложки  $n_3 = 1.50$ . Выражения для коэффициентов  $A$ ,  $B$  и  $C$  приведены в [9, 10].

Решение системы уравнений (1) для определения оптических констант тонких пленок CuGaSe<sub>2</sub> находилось итерационными методами на компьютере. Для получения точного решения (1) необходимо правильно выбрать область начальных значений для  $n_2$  и  $k_2$ , иначе можно получить решение, не имеющее физического смысла. Для этой цели нами были проведены расчеты  $n_2$  и  $k_2$  методом последовательных приближений [9, 10]. В этом методе для расчетов используется только интерференционный спектр пропускания системы пленка—подложка и значения искомых величин находят в точках экстремумов. Результаты решения системы уравнений (1) представлены на рис. 1, 2. Коэффициент поглощения  $\alpha$  определялся из выражения  $\alpha = 2\pi k/\lambda$ , действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости — из выражений  $\epsilon_1 = 2nk$ ,  $\epsilon_2 = n^2 - k^2$ . Необходимо отметить, что спектральный ход

Рис. 2. Коэффициент поглощения тонких слоев CuGaSe<sub>2</sub>.



интерференцией света в этих слоях, поскольку оптические постоянные в них фактически зависят от фазовой толщины пленки  $\varphi = 4\pi nd/\lambda$  ( $d$  — геометрическая толщина пленки). Как было установлено ранее, наиболее сильные нерегулярности оптические константы тонких пленок обнаруживаются в дальней инфракрасной области спектра [8, 10].

Известно, что CuGaSe<sub>2</sub> является прямозонным полупроводником, проявляющим вблизи фундаментального края поглощения сложную структуру, обусловленную расщеплением валентной зоны под действием тетрагонального поля кристаллической решетки ( $\Delta_{cr}$ ) и спин-орбитального взаимодействия ( $\Delta_{so}$ ) [12, 13]. Энергетические переходы валентная зона—зона проводимости, обычно обозначаемые  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , соответствуют переходам  $\Gamma_7 \rightarrow \Gamma_6$ ,  $\Gamma_6 \rightarrow \Gamma_6$  и  $\Gamma_7 \rightarrow \Gamma_6$ . Согласно квазикубической модели [12], расщепление валентной зоны в CuGaSe<sub>2</sub> является результатом гибридизации  $d$ -уровней меди и  $p$ -уровней селена, характерной для халькопиритных структур, в частности для CuGaSe<sub>2</sub>. Теоретически предсказаны и экспериментально установлены из спектров  $\lambda$ -модулированного и электроотражения на монокристаллах CuGaSe<sub>2</sub> [12, 13] следующие энергетические переходы:  $E_g = 1.68$  эВ,  $\Delta_{cr}^{th} = -0.03$ ,  $\Delta_{cr}^{th} = -0.09$ ,  $\Delta_{so}^{th} = 0.44$ ,  $\Delta_{so}^{th} = 0.23$  эВ и высокоенергетический переход  $E_D = 2.68$  эВ, обусловленный переходами электронов из  $3d$ -уровня меди в валентной зоне в зону проводимости.

Необходимо отметить, что результаты исследований краевого поглощения тонких пленок CuGaSe<sub>2</sub>, приведенные в литературе, довольно противоречивы. Переход, обусловленный расщеплением валентной зоны под действием тетрагонального поля кристаллической решетки, авторы [3, 4] относят к прямому запрещенному переходу в отличие от авторов [12, 13]. Некоторые переходы в [3, 4] на поликристаллических пленках вообще не были установлены, а исследования проводились с использованием только спектров пропускания.

Анализ зависимости  $\alpha(\hbar\omega)$  (рис. 2), проведенный в настоящей работе, показал, что существенный вклад в структуру краевого поглощения пленок CuGaSe<sub>2</sub> вносят прямые разрешенные переходы, определенные из соотношений  $(\alpha, \hbar\omega)^2 = A_n^*(\hbar\omega - E_g)$  в различных энергетических интервалах вплоть до 3 эВ: переход  $A$ , соответствующий переходу валентная зона—зона проводимости с  $E_A = 1.68$  эВ; переход  $B$ , обусловленный расщеплением валентной зоны под действием тетрагонального поля кристаллической решетки  $E_B = 1.78$  эВ ( $\Delta_{cr} = 0.10$  эВ); переход  $C$ , связанный со спин-орбитальным расщеплением валентной зоны с  $E_c = 1.98$  эВ ( $\Delta_{so} = 0.30$  эВ), и высокоенергетический переход  $D$  с  $E_D = 2.60$  эВ, обусловленный переходами электронов из  $3d$ -уровня меди в валентной зоне в зону проводимости.

Полученные значения переходов в тонких пленках CuGaSe<sub>2</sub> достаточно хорошо совпадают с данными [12, 13] для подъемных кристаллов.

зависимостей  $n$ ,  $k$ ,  $\alpha$  и их абсолютные значения хорошо совпадают с аналогичными данными для объемных кристаллов ( $n \approx 2.4 \div 3.4$ ,  $\alpha \approx 10^4 \div 10^5$  см<sup>-1</sup>) [1]. В ближней ИК области спектра наблюдается аномальный ход дисперсионных зависимостей оптических констант в совершенных тонких пленках. Его можно объяснить прежде всего

В заключение необходимо отметить, что в настоящей работе впервые проведен расчет оптических констант высокоориентированных лазерноисажденных пленок CuGaSe<sub>2</sub> по спектрам пропускания и отражения в видимой и ближней ИК областях решением системы трансцендентных уравнений с учетом интерференции в системе пленка—подложка. Установлено, что в области краевого поглощения тонкие пленки CuGaSe<sub>2</sub>, как и объемные монокристаллы, имеют сложную структуру.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] S. Lawrence. J. Phys. Chem. Sol., 27, 1 (1966).
- [2] L. Mandel, K. D. Toulinson, M. J. Hampshire. J. Cryst. Growth, 36, 152 (1976).
- [3] W. Horng, H. Neumann, B. Shumann, G. Kuhn. Phys. St. Sol. (b), 85, K57 (1978).
- [4] K. T. Ramakrishna Reddy, P. Jayarama Reddy. J. Mater. Sci. Lett., 8, 110 (1989).
- [5] J. V. Bodnar, V. F. Gremenok, E. P. Zaretskaya, I. A. Victorov. Thin Sol. Films, 207, 54 (1992).
- [6] И. В. Боднарь, В. Ф. Гременок, И. А. Викторов, Е. П. Зарецкая. Тез. докл. VIII Всес. конф. по росту кристаллов, 284. Харьков (1992).
- [7] И. Е. Потапов, А. В. Раков. ЖПС, 14, 140 (1971).
- [8] С. Метфесель. Тонкие пленки, их изготовление и измерение. М. (1963).
- [9] В. В. Киндяк, В. В. Моисеенко, А. С. Киндяк, В. Ф. Гременок, Н. Н. Корень, К. П. Григорьев. ФТП, 25, 1655 (1991).
- [10] В. В. Киндяк, А. С. Киндяк, В. Ф. Гременок. Докл. АНБ, № 12 (1992).
- [11] А. В. Раков. Спектрофотометрия тонкопленочных полупроводниковых структур. М. (1975).
- [12] J. L. Shay, B. Tell, H. M. Kasper, L. M. Shiavone. Phys. Rev. B, 5, 5003 (1972).
- [13] B. Tell, P. M. Bridenbaugh. Phys. Rev. B, 12, 3330 (1975).

Редактор В. В. Чалдышев

---